

名古屋大学 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 第3回ユーザーズミーティング

日時: 平成31年3月14日(木)13時00分～17時00分
場所: 名古屋大学 VBL3階 ペンチャーホール

趣旨

本学超高压電子顕微鏡施設は、2010年反応科学超高压走査透過電子顕微鏡の導入及び2011年文部科学省ナノテクノロジープラットホーム微細構造解析への参画を機に大きく生まれ変わりました。最先端の電子顕微鏡を幅広い分野のご研究に更に生かしていただくために、学内外のユーザーの方々を対象に施設の技術情報の公開及び施設スタッフとの交流を図る目的で、昨年度に引き続き今年度も第3回ユーザーズミーティングを企画いたしました。是非この機会を利用して皆様の施設へのご意見・ご要望などをいただければ幸いです。

プログラム

13:00 挨拶 未来材料・システム研究所 超高压電子顕微鏡施設 施設長 武藤 俊介

13:10 特別講演

「新規導入のHITACHI製FIB/SEM ETHOSの紹介」

株式会社 日立ハイテクサイエンス 中谷 郁子

- 休憩 -

14:00 ユーザー講演①

「プラズマ照射下その場透過電子顕微鏡観察システムの開発」

工学研究科 近藤 博基

14:30 ユーザー講演②

「無機化合物における結晶転位のコア構造と機能」

工学研究科 中村 篤智

- 休憩 -

15:20 ユーザー講演③

「超高压電子顕微鏡施設を活用した全固体Li電池の研究開発」

工学研究科 入山 恭寿

16:00 ユーザー講演④

「高性能電子顕微鏡技術と連携した自動車排ガス浄化触媒のナノ組織制御」

未来材料・システム研究所 小澤 正邦

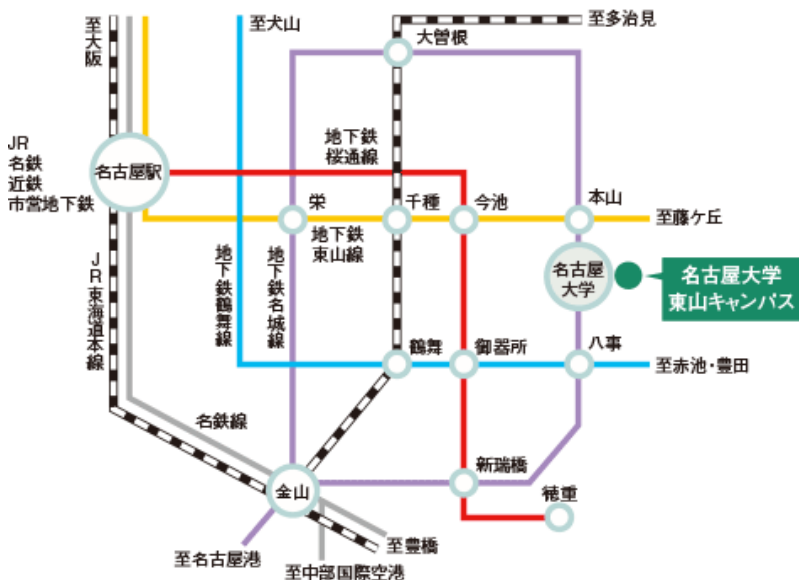
16:40 技術相談(希望者のみ、個別対応)

アクセス



名古屋大学
ベンチャービジネスラボ
トリー

地下鉄名城線「名古屋大
学」下車 1番出口 徒歩3
分



名古屋駅から
名古屋市営地下鉄東山線「本山」駅で
名城線右回りに乗り換え
「名古屋大学」駅下車。
所要時間約30分

金山駅から
名古屋市営地下鉄名城線左回りで「名
古屋大学」駅下車
所要時間21分

問い合わせ:名古屋大学未来材料・システム研究所
超高圧電子顕微鏡施設 微細構造解析PF
TEL 052-789-3632 E-mail nanoplat@nagoya-microscopy.jp

名古屋大学未来材料・システム研究所
超高压電子顕微鏡施設
第3回 ユーザーズミーティング
参加申込書

所属

氏名

連絡先

E-mail

所属

氏名

連絡先

E-mail

E-mailまたはFAXでお申込みください。
当日参加も可能です。参加費は無料です。

E-mail nanoplat@nagoya-microscopy.jp

FAX 052-789-3174